

管理番号

GA1149

検査日	2019年 10月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	微小寸法測定装置	電源電圧	1φ 100V/15A	XY電動ステージ 駆動 スケール	ACサーボモータ (1μm単位)
型式	WF-R55UV-H5	周波数	50/60Hz		リニアスケール (0.1μm単位)
メーカー名	(株)日立国際電気	ワークサイズ ワーク高さ	φ100、φ125、φ150ウエハ	位置決め精度	±3μm
機械Ser.No	A013973		525~625μm	ステージ部ストローク	150mm
製造年月	2006年11月	ユーティリティ	Air:5.9×10 ³ Pa VAC:35kPa	寸法	1730×1000×1680mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

装置概要

・光学顕微鏡及びCCTVカメラ装置、XY電動ステージを組み合わせ微小寸法物の線幅を非接触で比較測定する装置

- 1.装置起動⇒起動時、一連の動作イニシャライズ及び異常音・・・問題なし。
- 2.マニュアルX-Yステージ及びロボット動作確認・・・問題なし。
- 3.Sample測定確認・・・問題なし。別紙参照

※取説より抜粋:本装置は比較測定機ですので、既知の試料で寸法比較してから測定して下さい。

【測定部 視野(カメラCCD:1/3型)】

対物レンズ	モニタ視野(X×Y)μm(±10%)	用途	接眼レンズ
150 _x : (UV): 150/0.90(UV)365nm	22×20	測定用	HC PLAN10×/25
100 _x : HCX PL FLUOTAR100 ×/0.90 BD	32×30	測定用	
50 _x : HCX PL FLUOTAR50× /0.80 BD	64×60	測定用	
20 _x : HCX PL FLUOTAR20× /0.50 BD	160×150	測定用	
5 _x : HCX PL FLUOTAR5× /0.15 BD	620×580	位置認識用	

取扱説明書:有 OS:WindowsXP

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[10 Hr]

※測定は全て手動計測にて実施確認。

検査担当者[雨宮]



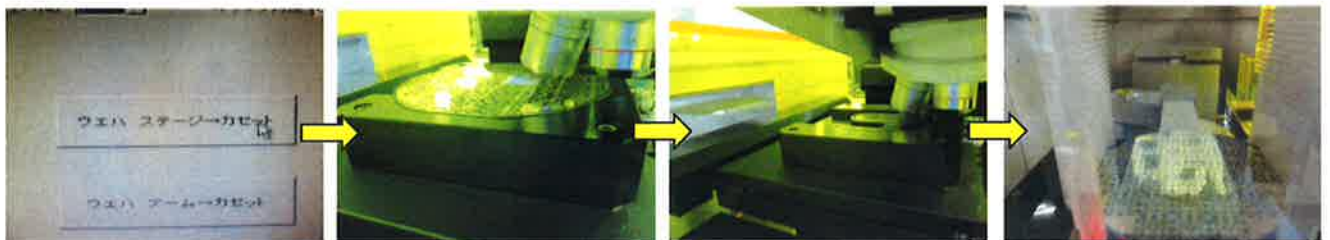
【ロボット搬送チェック(Wafer Load)及び測定】

(※Wafer Size φ6")

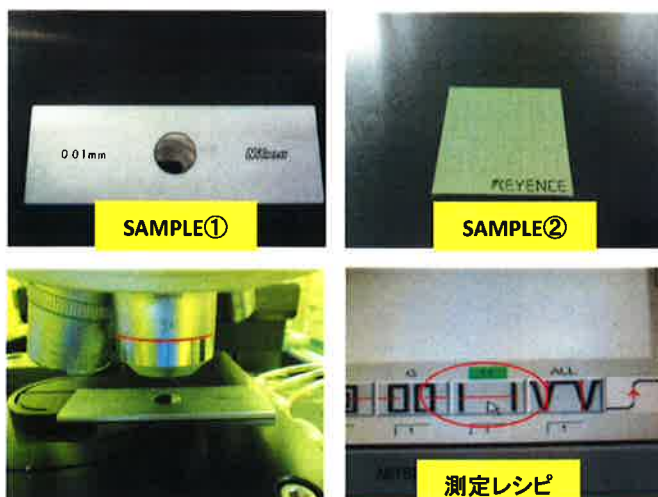


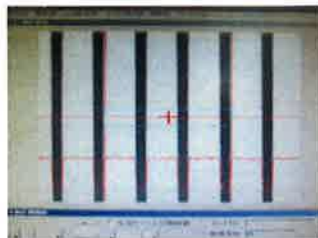
VAC ON時のカウンター表示

【測定終了後ロボット搬送チェック(Wafer Un Load)】

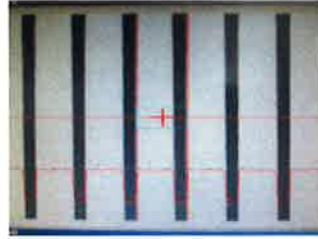
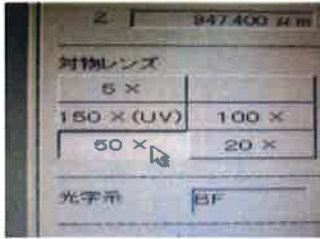


【基準Sample測定(手動計測)】

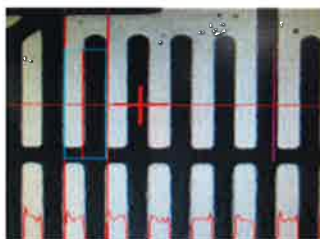




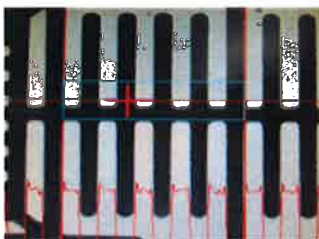
SAMPLE①
対物レンズ20倍
にて測定及び結果



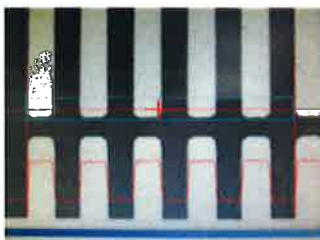
SAMPLE①
対物レンズ50倍
にて測定及び結果



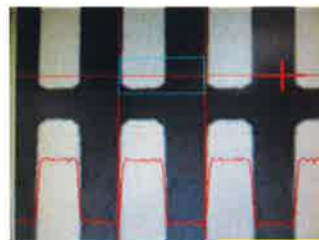
SAMPLE②
対物レンズ20倍
にて測定及び結果



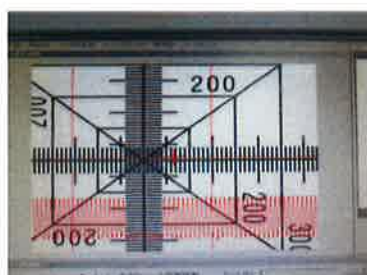
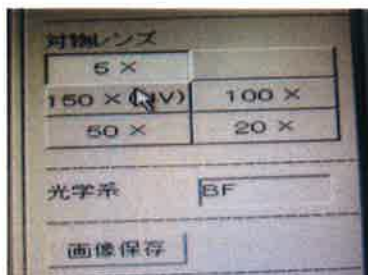
SAMPLE②
対物レンズ20倍
にて測定及び結果



SAMPLE②
対物レンズ50倍
にて測定及び結果



SAMPLE②
対物レンズ100倍
にて測定及び結果



SAMPLE②
対物レンズ5倍画像
(参考)